

⑩ 日本国特許庁(J P)

⑪ 特許出願公表

⑫ 公表特許公報(A)

昭64-500072

⑬ Int. Cl.<sup>4</sup>  
H 01 L 21/68

識別記号

庁内整理番号  
A-7454-5F審査請求 未請求  
予備審査請求 未請求

⑭ 公表 昭和64年(1989)1月12日

部門(区分) 7(2)

(全16頁)

⑮ 発明の名称 モジューラ半導体ウェーハ移送及び処理装置

⑯ 特 願 昭62-502482

⑰ 出 願 昭62(1987)4月6日

⑱ 翻訳文提出日 昭62(1987)12月28日

⑲ 国際出願 PCT/US87/00799

⑳ 国際公開番号 WO87/06561

㉑ 国際公開日 昭62(1987)11月5日

優先権主張 ㉒ 1986年4月28日 ㉓ 米国(U S) ㉔ 856,738

⑳ 発 明 者 スターク、ローレンス アール アメリカ合衆国カリフォルニア州95120 サノゼ、マウント・ウェ  
リントン・ドライブ6632㉑ 発 明 者 ターナー、フレデリック アメリカ合衆国カリフォルニア州94087 サニーベイル、ビッター  
ン・ドライブ1478㉒ 出 願 人 バリアン・アソシエイツ・イン アメリカ合衆国カリフォルニア州94303 バロ・アルト、ハンセ  
ン・ウエイ611

㉓ 代 理 人 弁理士 竹内 澄夫

㉔ 指 定 国 A T(広域特許), B E(広域特許), C H(広域特許), D E(広域特許), F R(広域特許), G B(広域特許), I T  
(広域特許), J P, K R, L U(広域特許), N L(広域特許), S E(広域特許)

## 特許(内容に変更なし)

## 請 求 の 範 囲

1. ウェーハ移送及び処理装置であって、
  - a) 第1の複数の管接統口と第2の複数の管接統口を有する移送真空チェンバであって、前記第1及び第2の複数の管接統口の各々が前記チェンバの内側と外側に通じているところの移送真空チェンバ、
  - b) 前記第1及び第2の複数の管接統口の各々を開閉するためのバルブ手段、
  - c) 前記管接統口の1つの前記バルブ手段の外側に接続されたウェーハ処理チェンバ及び、前記第1及び第2の複数の管接統口の別の1つで、その管接統口のための前記バルブ手段の外側に接続された処理チェンバ、
  - d) ウェーハを前記第1の複数の管接統口の選択された1つから前記チェンバ内に移送し、次に、前記第1の複数の管接統口の選択されたものに移すための前記チェンバ内の第1移送手段、
  - e) 前記チェンバ内にあって、ウェーハを前記第2の複数の管接統口の選択された1つから前記チェンバ内に移送し、次に、前記第2の複数の管接統口の選択されたものに移すための第2移送手段、
  - f) ウェーハが前記第1の複数の管接統口の選択されたあらゆる第1の管接統口から前記第2の

複数の管接統口の選択されたあらゆる第2の管接統口へ移送可能なようにウェーハを前記第1移送手段から前記第2移送手段へ移すために、前記第1移送手段と前記第2移送手段と協力する前記チェンバ内の移送手段、

とから成るところの装置。

2. 請求の範囲第1項に記載された装置であって、前記移送手段が、ウェーハが前記第2の複数の管接統口の選択されたあらゆる第1の管接統口から前記第2の複数の管接統口の選択されたあらゆる第1の管接統口へ移送可能なようにウェーハを前記第2移送手段から第1移送手段へ移すための手段を有するところの装置。
3. 請求の範囲第1項に記載された装置であって、前記移送手段が、ウェーハを所望の回転方向に位置決めするための手段を有するところの装置。
4. 請求の範囲第1項に記載された装置であって、前記第1移送手段が前記チェンバの内側から前記第1の複数のあらゆる前記管接統口の選択された1つを通して前記チェンバの外側に伸びることが可能であるところの装置。
5. 請求の範囲第1項に記載された装置であって、前記第1移送手段が前記チェンバの第1部分に置かれ、前記第2移送手段が前記チェンバの第2部分に置かれ、前記チェンバの前記第1及び第2部

BEST AVAILABLE COPY